

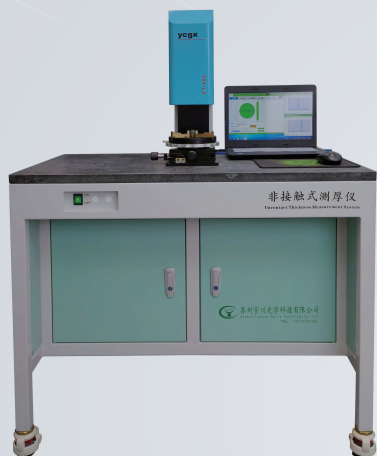
● 仪器说明

随着光学成像系统要求越来越清晰，对光学镜头要求也越来越高，特殊偏软牌号的光学材料也得到更加广泛应用，传统的接触式测量方式容易造成镜片表面损坏，测量效率偏低，精度也因人为因素存在不同程度偏差。

依据行业发展前景和市场需求，宇川光学研发团队耗时数月成功研发出了这款“非接触式测厚仪”，以实现光学原器件无损测量。

● 主要用途

用于球面，平面光学元件中心厚度&矢高深度测量。



NO:	项目	规格
1	厚度测量范围	≅23.5mm
2	外径测量范围	≅200mm
3	适用产品类型	球面/平面透明/不透明光学零件
4	识别精度	0.001mm(1um)
5	重复精度	±0.003mm
6	测量光斑	28um
7	电源	110/240VAC.50/60HZ
8	设备尺寸	1000*650*1150(长*宽*高)
9	仪器重量	约75kg
10	出厂配置	控制器,测量单元,笔记本电脑,工作台

● 软件测量界面

